# 第一章 MOS管

#### 1.1 MOS 的基本结构

MOS 由源极漏极栅极和衬底构成。源漏为 n 型则为 nMOS, 为 p 型则为 pMOS。

# 1.2 MOS 的平衡能带图

为了使得费米能级连续,接触处的能带下拉,由于氧化物是刚性下拉,另一侧也下降。

$$\frac{p}{p'} = \exp(\frac{\phi_S}{kT})$$

### 1.3 理想 MOS 电容

通过外接电压, 使得氧化物能级变平。

通过外加偏置,可以得到积累、耗尽与反型几种状态。

#### 1.4 阈值电压

反型的临界:表面电子浓度与内部空穴浓度相等时的外接电压。

$$\frac{n_i^2}{N_A} \exp \frac{\phi_S}{kT} = N_A$$

$$\phi_S = kT2\log(N_A/n_i)$$

那么

$$V_G = V_{ox} + \phi_S = \frac{Q_S(\phi_S)}{C_{ox}} + \phi_S$$

## 1.5 低于阈值的状态

由于空穴沿位置上升速度极快,可以看作是一个冲激函数。而积累时  $\phi_S \approx 0$ 

$$V_G = \frac{Q_S}{C_{ox}}$$

激发的载流子全部存在于界面上, 电压全部落在氧化层上,  $V_G \approx V_{ox} = Q_S(\phi_S)/C_{ox}$ 。 类似的, 反型之后电子浓度也会出现急剧上升, 电压的进一步上升基本都会落在  $V_{ox}$ 上, 用于能带弯曲的电压只需一小部分就可以引起极大的电荷变化。

## 1.6 小信号电容

对于积累时,宽度不变,电荷变化;而耗尽时,类似 PN 结,宽度会发生变化,而电荷保持¹在 $-N_A$ ,是一个串联的电容;反型会增加极薄的反型层,空间电荷区基本稳定,但是反型电荷由 $\delta$ 近似会发生变化。

$$C_S = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{W}, ext{ where } W \propto \sqrt{V_{bi} - V_A}$$

#### 1.7 高于阈值的状态

电荷随着  $V_G$  线性增长, 随着  $V_{th}$  指数增长。

$$V_G = \phi_S + V_{ox}$$

$$= \phi_S + E_{ox} x_{ox}$$

$$= \phi_S - \frac{Q_i + Q_F}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

而阈值电压满足

$$V_{th} = 2\phi_F + E_{ox}x_{ox}$$

$$= 2\phi_F - \frac{Q_i(2\phi_F) + Q_F}{\kappa_{ox}\epsilon_0}$$

$$V_G - V_{th} = (\phi_S - 2\phi_F) - \frac{Q_i(\phi_S - Q_i(2\phi_F))}{\kappa_{ox}\epsilon_0}x_{ox}$$

$$\approx -\frac{Q_F(\phi_S) - Q_F(2\phi_F)}{\kappa_{ox}\epsilon_0}x_{ox}$$

$$= \frac{Q_i}{\epsilon_r\epsilon_0}$$

小信号电容表示为

$$C_G = \frac{\mathrm{d}Q_G}{\mathrm{d}V_G}$$

$$\frac{\mathrm{d}V_G}{\mathrm{d}Q_G} = \frac{Q_S/C_{ox}}{\mathrm{d}Q_G} + \frac{\mathrm{d}\phi_S}{\mathrm{d}Q_S}$$

<sup>1</sup>电离杂质